Qubed 装置一覧表

2026/10/9

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	
Qubed001	希釈冷凍機計測システムA （KIDE1000Q, 4-8GHz）	2-11B	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed002	希釈冷凍機計測システムB （XLD-1000 100Q, 4-8GHz, Quantum Machine）	2-11B	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed003	希釈冷凍機計測システムC （XLD-1000 100Q, 4-12GHz, Keysight OCS）	2-11B	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed004	希釈冷凍機計測システムD （XLD-1000 100Q, 4-12GHz, Keysight OCS, 光ファイバー実装）	2-11B	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed005	希釈冷凍機計測システムE （XLD-1000 256Q, 4-8GHz, 3PTR, Keysight OCS）	2-11B	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed006	J-Dry (formfactor JANIS) _A	2-2D 1F	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed007	J-Dry (formfactor JANIS) _B	2-2D 1F	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed008	XLD (with out Bottom load)	2-2D 1F	希釈冷凍機	低温物性評価装置
Qubed009	XLD (with Bottom load) _A	2-2D 1F	希釈冷凍機	低温物性評価装置
Qubed010	XLD (with Bottom load) _B	2-2D 1F	希釈冷凍機	低温物性評価装置
Qubed011	XLD (with Bottom load) _C	2-2D 1F	希釈冷凍機	低温物性評価装置
Qubed012	LD400 _A	2-2D 1F	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed013	LD400 _B	2-2D 1F	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed014	LD400 _D	2-2D 1F	希釈冷凍機	量子デバイス評価装置
Qubed015	タンデム冷凍機	2-2D 1F	測定装置	低温物性評価装置
Qubed016	QuantumDesign PPMS	2-2D 1F	測定装置	低温物性評価装置
Qubed017	QuantumDesign MPMS	2-2D 1F	測定装置	低温物性評価装置
Qubed018	４Kプローバー（IQ2000 formfactor）	2-2D 1F	プローバー	高周波プローバー
Qubed019	20Kプローバー（w tuner）	2-2D 1F	プローバー	高周波プローバー
Qubed020	シリコンフォトニクスプローバー	2-2D 2F	プローバー	光学プローバー
	RF測定装置		測定装置	
	DC測定装置		測定装置	